

SCAN TECH 2022

SEM の基礎 手取り足取り 前処理・観察・分析まで

日 時： 2022 年 8 月 26 日（金） 9:50～17:00

場 所： 理化学研究所 横浜キャンパス 交流棟ホール

参加費： 顕微鏡学正会員（法人会員除く）・学生 無料 / 非学会員 1,000 円

開会挨拶（9 時 50 分）

理化学研究所・豊岡 公徳

基礎講座（10 時～11 時 30 分）

1. ミクロトームによる材料系試料の SEM 試料作製

ライカマイクロシステムズ・長澤 忠広

2. Low-Vacuum が High-Value！卓上低真空走査電顕の特性を活かした生体構造解析と
新たな金ナノ粒子免疫標識法の未知なる可能性

宮崎大学・澤口 朗

3. 金属材料の機械的性質の理解と評価のための走査電子顕微鏡法とその周辺技術

九州大学・光原 昌寿

企業展示（11 時 30 分～13 時）

SEM メーカーセッション（13 時～14 時）

休憩 10 分

分析基礎講座（14 時 10 分～15 時 10 分）

4. EDX 法 -- 元素分析の基礎と分析条件の影響 --

オックスフォード・インストゥルメンツ・三井 千珠

5. EBSD 法 -- 結晶方位の表現と結晶方位マップの見方 --

TSL ソリューションズ・鈴木 清一

展示企業ショートプレゼンテーション（15 時 10 分～15 時 50 分）

特別講演（15 時 50 分～16 時 20 分）

6. 顕微鏡観測された 2 次元粒径分布及び粒子形状の 3 次元変換

産業技術総合研究所・上田 高生

閉会挨拶

ファインセラミックスセンター・横江 大作

オンライン終了

情報交換会（16 時 30 分～17 時）

※1： コロナウイルス感染症の状況によって開催方法・開催場所を変更する可能性があります。